## (19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

## 特許第3657096号

(P3657096)

(45) 発行日 平成17年6月8日 (2005.6.8)

(24) 登録日 平成17年3月18日 (2005.3.18)

(51) Int.C1.<sup>7</sup> HO1L 31/04

FI HO1L 31/04

Е

請求項の数 6 (全 9 頁)

<ul> <li>(21)出願番号</li> <li>(22)出願日</li> <li>(65)公開番号</li> <li>(43)公開日</li> <li>審査請求日</li> </ul>	特願平9-285748 平成9年10月17日 (1997.10.17) 特開平11-121774 平成11年4月30日 (1999.4.30) 平成15年9月9日 (2003.9.9)	(73)特許権者 (74)代理人	<ul> <li>6 000005049</li> <li>シャープ株式会社</li> <li>大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号</li> <li>100065248</li> <li>弁理十 野河 信太郎</li> </ul>
		(72)発明者	高本達也
			埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号
			株式会社ジャパンエナジー内
		(72)発明者	池田 英治
			埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号
			株式会社ジャパンエナジー内
		審査官	柏崎康司
			最終百に続く

(54) 【発明の名称】GaAs太陽電池

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1導電型のベース層の表面上に第2導電型のエミッタ層を有するGaAs太陽電池において、

前記エミッタ層の表面上に積層された第2導電型In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層で形成され、<u>組成比</u> <u>×が0.500.53の範囲に設定され、前記エミッタ層との格子不整合率が0.3%</u> 以内に設定され、エミッタ層表面での再結合を抑制する第1窓層と、

該第1窓層の表面上に積層された第2導電型(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形成され 、少数キャリアに対するポテンシャル障壁を形成する第2窓層と、

を備えたことを特徴とするGaAs太陽電池。

【請求項2】

第1導電型のベース層の表面上に第2導電型のエミッタ層を有するGaAs太陽電池において、

前記エミッタ層の表面上に積層された第2導電型In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層で形成され、エミッ タ層表面での再結合を抑制する第1窓層と、

該第1窓層の表面上に積層された第2導電型(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形成され、 <u>組成比yが0.500.53の範囲に設定され、前記第1窓層のInGaP層との格</u> <u>子不整合率が0.3%以内に設定され、</u>少数キャリアに対するポテンシャル障壁を形成す る第2窓層と、

を備えたことを特徴とするGaAs太陽電池。

(2)

【請求項3】

第1導電型のベース層の表面上に第2導電型のエミッタ層を有するGaAs太陽電池において、

前記エミッタ層の表面上に積層された第2導電型In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層で形成され、エミッ タ層表面での再結合を抑制する第1窓層と、

該第1窓層の表面上に積層された第2導電型(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形成され、 (<u>組成比×が0.7 1.0の範囲に設定され、間接遷移型材料よりなる</u>少数キャリアに 対するポテンシャル障壁を形成する第2窓層と、

を備えたことを特徴とするGaAs太陽電池。

【請求項4】

10

20

第1導電型のベース層の表面上に第2導電型のエミッタ層を有するGaAs太陽電池において、

前記エミッタ層の表面上に積層された第2導電型In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層で形成され、<u>組成比</u> <u>×が0.500.53の範囲に設定され、記エミッタ層との格子不整合率が0.3%以</u> 内に設定され、エミッタ層表面での再結合を抑制する第1窓層と、

該第1窓層の表面上に積層された第2導電型(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形成され、組成比×が0.71.0の範囲に、組成比yが0.50設定され、間接遷移型材料よりなる前記第1窓層のInGaP層との格子不整合率が0.3%以内に設定され、少数キャリアに対するポテンシャル障壁を形成する第2窓層と、

を備えたことを特徴とするGaAs太陽電池。

【請求項5】

前記第1窓層を形成するIn<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層は0.05µm以下の膜厚で形成されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のGaAs太陽電池。

【請求項6】

<u>請求項1乃至5いずれかに記載の太陽電池の上に、トンネル接合を介してInGaP太</u> 陽電池を積層したことを特徴とする積層型太陽電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、GaAs太陽電池に関し、特にベース層表面上にエミッタ層を備えこのエミッ 30 タ層表面上に窓層を有するGaAs太陽電池に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

図 6 は従来技術に係る G a A s 太陽電池の構成を示す断面図である。 G a A s 太陽電池は p型 G a A s 基板 3 1 の表面上にp型 G a A s バッファ層 3 2 、 p型 I n G a P - B S F 層 3 3 、 p型 G a A s ベース層 3 4 、 n型 G a A s エミッタ層 3 5 の各層を備える。 【 0 0 0 3 】

この種のGaAs太陽電池にはn型GaAsエミッタ層35の表面上に窓層36が形成される。窓層36は、太陽光を入射する表面近傍で生成された少数キャリアが表面欠陥等による再結合によって表面で消滅することを抑制できる。窓層36には、下地層であるn型GaAsエミッタ層35との格子定数がほぼ等しく、エネルギギャップが大きくGaAsに対してポテンシャル障壁を形成し、可視光を透過する材料が選択される。特に、窓層36には光吸収係数の小さい間接遷移型の材料が選択されており、具体的にはA1GaAs、InGaP、A1InPのいずれかの材料の単層が使用されている。

[0004]

前記 p 型 G a A s 基板 3 1 の裏面には裏面電極 3 9 が形成され、窓層 3 6 の一部の表面上 には n 型 G a A s コンタクト層 3 7 を介して表面電極 4 0 が形成される。さらに、窓層 3 6 の他の一部の表面上には反射防止層 3 8 が形成される。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

10

20

40

前述のGaAs太陽電池の窓層36を形成する材料のうち、Al<sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>Pは、エネル ギギャップが2.35eVで最も大きく、大きなポテンシャル障壁を形成できる点で有利 である。しかしながら、AlInPはAlGaAsと同様に組成元素にAlを含むために エピタキシャル成長時に酸素の影響を受け、窓層36とn型GaAsエミッタ層35との 界面において再結合中心が多発する。このため、再結合損失が大きくなるという問題があ った。一方、InGaPは組成元素にAlを含まないので、再結合中心が少ない高品質の 界面が得られやすい。しかしながら、InGaPは光吸収率が高いという問題があった。 【0006】

このように、従来技術に係るGaAs太陽電池においては、窓層36としていずれの材料 を選択しても充分な量子効率が期待でず、また充分な変換効率が期待できなかった。 【0007】

本発明は上記課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は量子効率を向上し、 さらに変換効率を向上できる G a A s 太陽電池を提供することにある。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、この発明は、第1導電型のベース層の表面上に第2導電型の エミッタ層を有するGaAs太陽電池において、前記エミッタ層の表面上に積層されたI n<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層で形成され、接合界面での再結合を抑制する第1窓層と、この第1窓層の 表面上に積層された(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形成され、少数キャリアに対するポ テンシャル障壁を形成する第2窓層と、を備えたことを特徴とする。

[0009]

このように構成されるGaAs太陽電池においては、組成元素にAlを含まないため再結 合中心の発生が減少できるInGaP層を第1窓層としてエミッタ層(GaAs)の表面 上に形成したので、エミッタ層と第1窓層との間の界面における再結合損失が減少できる 。そして、この再結合損失が減少された状態において、第2窓層にエネルギギャップが大 きくポテンシャル障壁が高いAlGaInP層が使用されるので、第2窓層で少数キャリ アを跳ね返すことができる。従って、表面近傍における少数キャリアの収集効率が向上で きるので、GaAs太陽電池の量子効率が向上でき、変換効率が向上できる。

【 0 0 1 0 】

さらに、この発明のG a A s 太陽電池は、前記第1窓層を形成するIn<sub>1-x</sub>G a<sub>x</sub> P 層の組 30 成比 x を 0 . 5 0 - 0 . 5 3 の範囲に設定し、前記第2窓層を形成する(A 1<sub>x</sub>G a<sub>1-x</sub>) <sub>y</sub> I n<sub>1-y</sub> P 層の組成比 x を 0 . 7 - 1 . 0の範囲に、組成比 y を 0 . 5 0 - 0 . 5 3 の範 囲にそれぞれ設定することを特徴とする。

【0011】

このように構成されるGaAs太陽電池において、第1窓層のIn<sub>1-×</sub>Ga<sub>×</sub>P層の組成比 ×が0.50-0.53の範囲に設定されることにより、第1窓層のInGaP層の格子 定数がエミッタ層のGaAsの格子定数に近似でき、格子不整合率が0.3%以内に設定 できる。この結果、格子欠陥や格子歪みの発生が減少でき、再結合中心の発生が減少でき るので、再結合損失がより一層減少できる。同様に、第2窓層の(A1<sub>×</sub>Ga<sub>1-×</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1</sub> -yP層の組成比 y が 0.50-0.53の範囲に設定されることにより、第2窓層のA1 GaInP層の格子定数が第1窓層のInGaP層の格子定数に近似できるので、再結合 損失が減少できる。そして、(A1<sub>×</sub>Ga<sub>1-×</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層の組成比×が0.7以上に設 定されることにより、A1GaInPは間接遷移型の材料になり、第2窓層における光吸 収量が減少できる。第2窓層で発生した少数キャリアは通常pn接合まで到達せずに消滅 してしまうので、第2窓層での光吸収量は小さい方が好ましい。

【0012】

さらに、この発明のG a A s 太陽電池は、第1窓層を形成する I n<sub>1-x</sub>G a<sub>x</sub> P 層を0.0 5 μ m 以下の膜厚で形成することを特徴とする。

【0013】

このように構成されるGaAs太陽電池においては、第1窓層における光吸収量が小さい 50

直接遷移型の材料であるΙ n G a P 層が実現できる。第1 窓層の膜厚は薄ければ薄いほど 光吸収量を小さくなる。さらに、Ι n G a P 層が0.05μm以下の薄膜で形成されるの で、安定した膜厚制御が行える。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1は本発明の第1の実施の形態 に係るGaAs太陽電池の構造を示す断面図である。GaAs太陽電池は、p型GaAs 基板1、p型GaAsバッファ層2、p型InGaP-BSF層(裏面電界層)3、p型 GaAsベース層4及びn型GaAsエミッタ層5を備え、さらに第1窓層6及び第2窓 層7を備える。これらのp型GaAsバッファ層2、p型InGaP-BSF層3、p型 GaAsベース層4、n型GaAsエミッタ層5、第1窓層6、第2窓層7の各層はp型 GaAs基板1の表面上に順次積層される。p型GaAs基板1の裏面には裏面電極10 が形成され、第2窓層7の一部分の表面上にはn型GaAsコンタクト層8を介して表面 電極11が形成される。さらに、第2窓層7の他の一部分の表面上には反射防止層9が形 成される。

【0015】

前記第1窓層6はn型GaAsエミッタ層5の表面上に直接積層されたIn<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層 で形成される。In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層は、組成元素にAlを含まないのでn型GaAsエミッ タ層5との界面において再結合中心を生成しにくく、再結合中心が少ない高品質な界面を 形成できる。In<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>P層の組成比×は0.50-0.53の範囲に設定され、In GaP層の格子定数がn型GaAsエミッタ層5の格子定数に近似でき、格子不整合率が 0.3%以内に設定できる。組成比×が0.50未満に設定されると、InGaP層の格 子定数がGaAsの格子定数よりも小さくなり、InGaP層の格子が伸びるので、格子 欠陥や歪みが発生しやすくなる。逆に、組成比×が0.53を超える場合には、InGa P層の格子定数がGaAsの格子定数よりも大きくなり、InGaP層の格子が縮むので 、同様に格子欠陥や歪みが発生しやすくなる。

【0016】

前記第2窓層7は第1窓層6の表面上に形成された(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層で形 成される。(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層はエネルギギャップが2.35eV(x=1の 場合)と大きいので、高いポテンシャル障壁が得られ、少数キャリアを跳ね返すことがで きる。(Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>P層の組成比×は0.7-1.0の範囲に設定され、組 成比yは0.50-0.53の範囲に設定される。0.50-0.53の範囲に組成比y が設定されることによって、第1窓層6と同様にAlGaInPの格子定数が第1窓層6 のInGaP層の格子定数に近似でき、格子不整合率が0.3%以内に設定でき、再結合 損失が減少できる。さらに、AlGaInP層の組成比×が0.7以上に設定されること によって、AlGaInPは間接遷移型の材料になり、第2窓層7における光吸収量が減 少できる。

【0017】

次に、図1を参照してGaAs太陽電池の製造プロセスを説明する。

[0018]

(1)まず、1×10<sup>19</sup> atoms/cm<sup>3</sup>の濃度でZnがドーピングされたp型GaAs基板1 を準備する。

[0019]

 (2)前記p型GaAs基板1の表面上に、p型GaAsバッファ層2、p型InGa PBSF層3、p型GaAsズース層4、n型GaAsエミッタ層5、第1窓層6、第 2窓層7の各層を順次積層する。これらの各層は有機金属気相成長(MOCVD)法によ り約700の成長温度で連続的に成膜され、各層の格子定数はp型GaAs基板1の格 子定数に対してほぼ等しくなるように形成される。p型GaAsバッファ層2の膜厚は0
 5µm、p型InGaP-BSF層3の膜厚は0.1µm、p型GaAsベース層の膜 厚は3µm、n型GaAsエミッタ層5の膜厚は0.1µmでそれぞれ形成される。第1 10

20

窓層 6 の膜厚は 0 . 0 1 0 . 0 5 μ m の範囲で形成され、好ましくは 0 . 0 1 μ m の膜厚 で生成される。第 1 窓層 6 である I n G a P 層は、膜厚が薄ければ薄いほど直接遷移型の 材料になり、光吸収量が小さくなる。第 2 窓層 7 の膜厚は 0 . 0 3 0 . 1 μ m の範囲で 形成され、好ましくは 0 . 0 3 μ m の膜厚で形成される。

[0020]

(3)前記第2窓層7の表面上にn型GaAsコンタクト層8を形成する。n型GaAs コンタクト層8はMOCVD法により成膜される。

【0021】

(4)前記 p 型 G a A s 基板 1 の 裏面 に p 型 の 裏面 電 極 1 0 を 形 成 す る 。 裏面 電 極 1 0 は A u メッキ に よ り 形 成 さ れ る 。

【0022】

(5)リフトオフ技術に従い、まず前記 n 型G a A s コンタクト層 8 の表面上の一部分が 開口されたマスクを形成する。このマスクの開口を通して露出する n 型G a A s コンタク ト層 8 の表面上の一部分、マスク上にそれぞれ A u - G e / N i / A u 層を蒸着し、約3 5 0 で数秒間の熱処理を行う。引き続き、 A u - G e / N i / A u 層の表面上に A u メ ッキを施し、 n 型の表面電極 1 1 を形成する。前記マスク及びマスク上の不要な n 型の表 面電極 1 1 は選択的に除去される。

【0023】

(6) n型の表面電極11をマスクとしてn型の表面電極11以外の領域に露出するn型 G a A s コンタクト層8をエッチングにより除去する。エッチングにはNH<sub>4</sub>OH:H<sub>2</sub>O 20 :H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>溶液が使用される。

【0024】

(7)そして、前記エッチングにより露出された第2窓層7の表面上に反射防止層9が形成される。反射防止層9はZnS/MgF2で形成される。これら一連の工程を施すことにより、GaAs太陽電池が完成する。

[0025]

図2は従来技術に係るGaAs太陽電池の分光感度特性図である。いずれも従来技術に係る単層のIn<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>P層を窓層とするGaAs太陽電池の分光感度特性と、単層のAl<sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>P層を窓層とするGaAs太陽電池の分光感度特性とを比較すると、AlI nP層を窓層とするGaAs太陽電池の方が短波長領域で量子効率が優れている。 【0026】

30

10

図3は従来技術に係るGaAs太陽電池、本実施の形態に係るGaAs太陽電池のそれぞれの分光感度特性図である。従来技術に係る単層で0.03µmの膜厚を有するAl<sub>0.5</sub> In<sub>0.5</sub>P層を窓層とするGaAs太陽電池の分光感度特性と、本実施の形態に係る0. 01µmの膜厚を有するIn<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>P層(第1窓層6)及び0.03µmの膜厚を有 するAl<sub>0.5</sub>In<sub>0.5</sub>P層(第2窓層7)の2層構造で窓層が形成されるGaAs太陽電池 の分光感度特性とを比較すると、明らかに2層構造の窓層を有するGaAs太陽電池の方 が短波長領域で量子効率が優れている。

[0027]

なお、量子効率以外の特性であるGaAs太陽電池の開放特性、曲線因子はそれぞれのG 40 aAs太陽電池において大差がないことが確認されており、本発明によって、当然、変換 効率が向上できる。

次に、本発明をInGaP/GaAs積層型太陽電池に適用した場合について説明する。 図4は本発明の第2の実施の形態に係るInGaP/GaAs積層型太陽電池のボトムセ ル構造を示す断面図である。InGaP/GaAs積層型太陽電池は、p型GaAs基板 12、p型GaAsバッファ層13、p型InGaP-BSF層14、p型GaAsベー ス層15、n型GaAsエミッタ層16、n型InGaP層で形成された第1窓層17、 n型AlInP層で形成された第2窓層18、n/p型InGaPトンネル接合層19、 p型AlInP-BSF層20、p型InGaP-BSF層21、p型InGaPベース 層22、n型InGaPエミッタ層23、n型AlInP窓層24を備える。これらp型GaAsバッファ層13からn型AlInP窓層24までの各層はp型GaAs基板12の表面上に順次積層される。p型GaAs基板12の裏面には裏面電極27が形成され、n型AlInP窓層24の一部分の表面上にはn型GaAsコンタクト層25を介して表面電極28が形成される。さらに、n型AlInP窓層24の他の一部分の表面上には反射防止層26が形成される。

【0029】

本実施の形態係るInGaP/GaAs積層型太陽電池において第1窓層17、第2窓層 18の基本的特性はそれぞれ前述の第1の実施の形態に係るGaAs太陽電池の第1窓層 6、第2窓層7と同等であるので、ここでの説明は省略する。また、基本的な製造プロセ 10 スも同等であるので、ここでの説明は省略する。

【 0 0 3 0 】

[0031]

図5は従来技術に係るInGaP/GaAs積層型太陽電池、本実施の形態に係るInG aP/GaAs積層型太陽電池のそれぞれの分光感度特性図である。従来技術に係るIn GaP/GaAs積層型太陽電池は、第1窓層17に相当するn型InGaP層がなく、 第2窓層18に相当するn型AlInP層の単層が形成される。従来技術に係る単層のn 型AlInP層を窓層とするInGaP/GaAs積層型太陽電池の分光感度特性と、本 実施の形態に係るn型InGaP層(第1窓層17)及びn型AlInP層(第2窓層1 8)の2層構造で窓層が形成されるInGaP/GaAs積層型太陽電池の分光感度特性 とを比較すると、2層構造の窓層を有するInGaP/GaAs積層型太陽電池の方が短 波長領域で量子効率が優れている。従って、InGaP/GaAs積層型太陽電池の変換 効率も向上できる。

20

30

【発明の効果】 本発明は、量子効率を向上しつつさらに変換効率が向上できるGaAs太陽電池を提供で きる。さらに、本発明は、同様に量子効率を向上しつつさらに変換効率が向上できるIn G a P / G a A s 積層型太陽電池を提供できる。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の第1の実施の形態に係るGaAs太陽電池の構造を示す断面図である。 【図2】従来技術に係るGaAs太陽電池の分光感度特性図である。 【図3】従来技術に係るGaAs太陽電池、本実施の形態に係るGaAs太陽電池のそれ ぞれの分光感度特性図である。 【図4】本発明の第2の実施の形態に係るInGaP/GaAs積層型太陽電池のボトム セル構造を示す断面図である。 【図5】従来技術に係るInGaP/GaAs積層型太陽電池、本実施の形態に係るIn G a P / G a A s 積層型太陽電池G a A s のそれぞれの分光感度特性図である。 【図6】従来技術に係るGaAs太陽電池の構成を示す断面図である。 【符号の説明】 1、12 p型GaAs基板 2、13 p型GaAsバッファ層 3、14、21 p型InGaP-BSF層 4、15 p型GaAsベース層 5、16 n型GaAsエミッタ層 6、17 第1窓層 7、18 第2窓層 8、25 n型GaAsコンタクト層 9、26 反射防止層 10、27 裏面電極 11、28 表面電極

19 n / p型InGaPトンネル接合層

20 p型AlInP-BSF層
 22 p型InGaPベース層
 3 n型InGaPエミッタ層
 24 n型AlInP窓層

【図1】



【図2】







(8)





## 【図6】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平08-204215(JP,A) 特開平05-067802(JP,A) 特開昭59-172780(JP,A)
- (58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, DB名)

H01L 31/04